

©1995 г.

## ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ СОСТОЯНИЙ В МДП СТРУКТУРАХ МЕТОДОМ ДВУХТЕМПЕРАТУРНОЙ ПОЛНОЙ ПРОВОДИМОСТИ

*Е.Н.Бормонтов, С.В.Котов, С.В.Лукин, С.В.Головин*

Воронежский государственный университет,

394000, Воронеж, Россия

(Получена 14 июля 1994 г. Принята к печати 29 сентября 1994 г.)

Представлена новая методика расчета энергетического спектра поверхностных состояний, их поперечных сечений захвата и параметра флуктуаций поверхностного потенциала, основанная на численной обработке кривых нормированной проводимости, полученных при двух различных температурах из диапазона 100–500 К. Результаты расчетов приведены в сравнении с данными, полученными методом Ядавы. Показаны преимущества нового метода по сравнению с известными.

### 1. Введение

Контроль энергетического спектра поверхностных состояний (ПС), определение их параметров и концентрации является важнейшим условием создания воспроизводимой полупроводниковой технологии. Наиболее корректным методом исследования ПС является метод проводимости, так как активная составляющая проводимости МДП структуры прямо связана с запаздыванием перезарядки этих состояний. В методе Николлиана-Гоетцбергера [1] эквивалентная параллельная проводимость ПС  $G_p$  рассчитывается по измеренным значениям малосигнальных проводимости  $G$  и емкости  $C$  МДП структуры и сравнивается с модельными теоретическими выражениями. Для нахождения параметров ПС строятся кривые нормированной проводимости  $G_p/\omega(\ln \omega)$  при фиксированном смещении, которые анализируются с помощью теории флуктуаций поверхностного потенциала [1]. Метод Николлиана-Гоетцбергера характеризуется высокой чувствительностью и может определять плотности ПС около  $10^8 \text{ см}^{-2} \text{ эВ}^{-1}$ . Однако он требует анализа проводимости в широком частотном диапазоне, что требует чрезмерных затрат времени и уникального дорогостоящего оборудования. С целью упрощения компьютерных расчетов Саймон, Брюс и Норас [2–4] предложили графические методы, основанные на определенном образом рассчитанных универсальных кривых.

Для увеличения производительности метода Николлиан, Гоеццбергер и Лопес [5] предложили определять энергетический спектр ПС с помощью кривых нормированной проводимости  $G_p/\omega(y_s)$ , снятых при двух частотах  $f_1$  и  $f_2$ . Однако данный метод также требует сложных численных расчетов и не учитывает спектральную зависимость флуктуаций поверхностного потенциала. Важный шаг в направлении совершенствования метода полной проводимости предпринял Ядава [6], который получил простое аналитическое выражение для нормированной проводимости и на его основе упростил расчет параметров ПС, а также впервые получил зависимость стандартного отклонения  $\sigma$  поверхностного потенциала от смещения.

Представляет интерес модифицировать метод Ядавы [6] на случай температурной зависимости нормированной проводимости ПС (при заданной частоте измерений  $\omega = \text{const}$ ). Преимуществом использования лишь одной фиксированной частоты является возможность применения цифровых измерителей импеданса с высокой точностью (4–5 разрядов).

## 2. Теория метода проводимости

Сначала остановимся на некоторых особенностях метода Ядавы. Трудности в методе проводимости возникают главным образом из-за невозможности точного вычисления интеграла в выражении для нормированной проводимости  $G_p/\omega$  в флуктуационной теории Николлиана–Гоеццбергера [1]:

$$\frac{G_p}{\omega} = \frac{qN_{ss}}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\ln(1 + \omega^2 \tau^2)}{\omega \tau} P(y_s) dy_s, \quad (1)$$

где  $q$  — заряд электрона,  $N_{ss}$  — плотность ПС,  $\tau$  — постоянная времени ПС,  $\omega$  — циклическая частота тестового сигнала,  $y_s$  — поверхностный потенциал в единицах  $kT/q$ ,  $P(y_s)$  — функция плотности вероятности. В качестве  $P(y_s)$  обычно берется гауссовская функция распределения

$$P(y_s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(y_s - \bar{y}_s)^2}{2\sigma^2}\right), \quad (2)$$

где  $\bar{y}_s$  — средний по границе раздела полупроводника и диэлектрика поверхностный потенциал,  $\sigma$  — его стандартное отклонение в единицах  $kT/q$ . Постоянная времени  $\tau$  связана с  $y_s$  следующим образом:

$$\tau = (\sigma_p \bar{V} p_0)^{-1} \exp y_s \quad (3)$$

где  $\sigma_p$  — поперечное сечение захвата основных носителей (в данном случае дырок),  $\bar{V}$  — средняя тепловая скорость носителей заряда,  $p_0$  — концентрация ионизированных акцепторов в полупроводнике.

Ядава [6] получил приближенное аналитическое выражение для нормированной проводимости путем упрощения выражения (1) в предположении, что  $\sigma \gg 0.7$ . Он показал, что при встречающихся

на практике стандартных отклонениях поверхностного потенциала ( $2 < \sigma < 3.5$ ) выражение

$$\frac{G_p}{\omega} = \frac{qN_{ss}}{2\sqrt{2\pi}\sigma} \frac{\pi}{(1-X)^{\sigma/2}} \frac{\exp(-aX^2 - b)}{\cos\left(\frac{\pi X}{2} \sqrt{\sigma/2}\right)}, \quad (4)$$

дает практически те же результаты, что и формула (1). Здесь  $X = \frac{\ln(\omega\bar{\tau})}{2\sigma^2}$ ,  $\bar{\tau} = (\sigma_p \bar{V} p_0)^{-1} \exp \bar{y}_s$  — среднее значение постоянной времени ПС,  $\bar{y}_s$  — средний по границе раздела поверхностный потенциал,  $a = \frac{\sigma}{2}(\sigma^2 + \frac{\pi^2}{4} - \frac{1}{\sigma^2+3})$ ,  $b = \frac{2}{\sigma^2+1.85}$ . Вывод основных соотношений метода Ядавы основан на выражении (4).

В методе Ядавы строятся две кривые нормированной проводимости  $G_p/\omega(y_s)$  (рис. 1): одна — при частоте  $f_1$ , другая — при частоте  $f_2$ . Далее рассматриваются два близких значения поверхностного потенциала  $y_{s1}$  и  $y_{s2} = y_{s1} + \Delta y$ , где  $\Delta y$  — настолько малая добавка, что в этом интервале основные параметры ПС можно считать постоянными. Вводятся следующие обозначения:

$$R_1 = \frac{(G_p/\omega) \text{ при частоте } f_1}{(G_p/\omega) \text{ при частоте } f_2} \text{ при поверхностном потенциале } y_{s1},$$

$$R_2 = \frac{(G_p/\omega) \text{ при частоте } f_1}{(G_p/\omega) \text{ при частоте } f_2} \text{ при поверхностном потенциале } y_{s2}.$$

Ядава [6] получил следующее соотношение:

$$\ln\left(\frac{R_1}{R_2}\right) = \frac{1}{4\sigma} \left[ 1 + \frac{0.7337(\sigma^2 + 1.6370)}{\sigma^2(\sigma^2 + 3)} \right] \Delta y \ln\left(\frac{f_1}{f_2}\right). \quad (5)$$

Исключая  $\sigma$ , все величины в этом выражении известны из двух экспериментальных кривых нормированной проводимости. Таким образом, уравнение (5) может быть численно решено относительно стандартного отклонения  $\sigma$ , например, методом Ньютона. Найденное значение  $\sigma$  будет справедливо для интервала значений поверхностного потенциала от  $y_{s1}$  до  $y_{s2}$ .

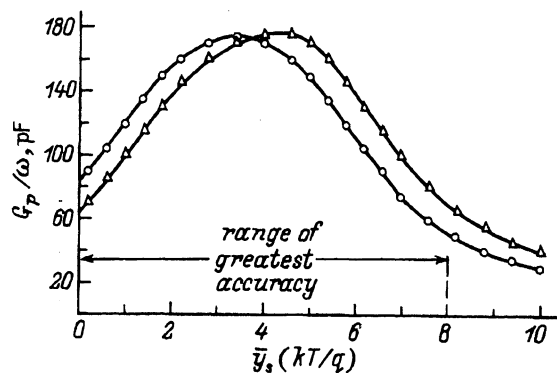


Рис. 1. Кривые нормированной проводимости  $G_p/\omega$  в зависимости от среднего поверхностного потенциала  $\bar{y}_s$ : кружки — при частоте  $f_1 = 1$  МГц, треугольники — при частоте  $f_2 = 500$  кГц. Площадь металлического электрода МДП структуры  $A = 1.18 \cdot 10^{-2}$  см<sup>2</sup>, концентрация акцепторной примеси в полупроводнике  $N_A = 2.68 \cdot 10^{16}$  см<sup>-3</sup>. Отмечен диапазон наибольшей точности метода.

Для нахождения других параметров ПС нужно рассмотреть выражение для  $R_1$ , которое имеет вид

$$R_1 = \frac{(1 - X_{21})^{\sigma/2} \cos\left(\frac{\pi X_{21}}{2} \sqrt{\sigma/2}\right)}{(1 - X_{11})^{\sigma/2} \cos\left(\frac{\pi X_{11}}{2} \sqrt{\sigma/2}\right)} \exp(-a(X_{11}^2 - X_{21}^2)), \quad (6)$$

где  $X_{11} = \frac{\ln(\omega_1 \bar{\tau}_1)}{2\sigma^2}$ ,  $X_{21} = X_{11} + \frac{\ln(\omega_2/\omega_1)}{2\sigma^2}$ ,  $\omega_1 = 2\pi f_1$ ,  $\omega_2 = 2\pi f_2$ ,  $\bar{\tau}_1$  — средняя постоянная времени ПС при среднем поверхностном потенциале  $y_{s1}$ .

После нахождения  $\sigma$  из уравнения (5) в выражении (6) осталась одна неизвестная величина —  $X_{11}$ , которую можно найти численными методами. Затем из выражения для  $X_{11}$  можно найти постоянную времени ПС  $\bar{\tau}_1$  при поверхностном потенциале  $y_{s1}$ , которая связана с сечением захвата дырок на ПС следующим соотношением:

$$\sigma_p = (\bar{\tau}_1 \bar{V} p_0)^{-1} \exp y_{s1}. \quad (7)$$

Плотность ПС при поверхностном потенциале  $y_{s1}$  можно найти из уравнения

$$\left(\frac{G_p}{\omega}\right)_{f_1, y_{s1}} = \frac{q N_{ss}}{2\sqrt{2}\pi\sigma} \frac{\pi}{(1 - X_{11})^{\sigma/2}} \frac{\exp(-aX_{11}^2 - b)}{\cos\left(\frac{\pi X_{11}}{2} \sqrt{\sigma/2}\right)}, \quad (8)$$

в котором все величины известны из экспериментальных данных или рассчитаны по уравнениям (5) и (6), кроме  $N_{ss}$ . Найденные с помощью выражений (7) и (8) сечение захвата  $\sigma_p$  и плотность  $N_{ss}$  соответствуют среднему поверхностному потенциалу  $y_{s1}$ . Повторяя эту же процедуру для других значений поверхностного потенциала, лежащих в области обеднения, находим спектральную зависимость параметров ПС. Для удобства расчетов желательно зафиксировать длину интервала  $\Delta y$ , которая входит в уравнение (5).

Преимуществами метода Ядавы являются простота численных расчетов и возможность учета зависимости  $\sigma$  от поверхностного потенциала. Для получения экспериментальных данных требуется измеритель импеданса с двумя фиксированными частотами. Мы предлагаем двухтемпературную модификацию метода Ядавы, для которой достаточно измерителя импеданса с одной фиксированной частотой измерения.

В работе [7] предложено определять параметры ПС с помощью метода термостимулированной проводимости. Измерения производились на фиксированной частоте, что позволило упростить аппаратную реализацию. Однако измерения проводимости МДП структуры в зависимости от температуры требуют учета изменения поверхностного потенциала с температурой, для чего необходимо решать уравнение [7]

$$d(T) - \beta \psi_s^{1/2}(T) - \delta \psi_s(T) = 0, \quad (9)$$

где  $d(T) = \delta(\phi_B(T) - \phi_B(T_0)) + \beta \psi_s^{1/2}(T_0) + \delta \psi_s(T_0)$ ,  $\beta = \frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_{ox}} \left(\frac{2qN_A d_{ox}^2}{\varepsilon_s}\right)^{1/2}$ ,  $\delta = 1 + \frac{q^2 N_{ss} d_{ox}}{\varepsilon_{ox}}$ ,  $\varepsilon_s$  и  $\varepsilon_{ox}$  — диэлектрические постоянные полупроводника

и диэлектрика соответственно,  $d_{\text{ок}}$  — толщина диэлектрика,  $T_0$  — температура, при которой значение  $\psi_s$  известно (например, комнатная).

В работе [7] также сделаны некоторые важные допущения, которые будут использованы и в нашей работе. Это предположения о независимости плотности и сечения захвата ПС от температуры в широком диапазоне температур (100–500 К). В целом же метод [7] является температурной модификацией известного метода Николлиана–Гоетцбергера [1] и сохраняет его недостатки, связанные со сложностью компьютерных расчетов. Ценность метода термостимулированной проводимости состоит в упрощении оборудования для его реализации. Цель нашей работы — создание метода, совмещающего преимущества метода Ядавы (простота компьютерных расчетов) и метода термостимулированной проводимости (использование одной фиксированной частоты при измерениях).

### 3. Двухтемпературный метод исследования поверхностных состояний

Предлагается измерять две зависимости эквивалентной параллельной проводимости МДП структуры от напряжения смещения при двух различных температурах  $T_1$  и  $T_2$ , лежащих в диапазоне от 150 до 500 К. На основе данных эксперимента рассчитываются две кривые нормированной проводимости  $G_p/\omega$  ( $y_s$ ) при температурах  $T_1$  и  $T_2$ . Введем по определению:

$$R_1 = \frac{(G_p/\omega) \text{ при температуре } T_1}{(G_p/\omega) \text{ при температуре } T_2} \quad \text{для поверхностного потенциала } y_{s1},$$

$$R_2 = \frac{(G_p/\omega) \text{ при температуре } T_1}{(G_p/\omega) \text{ при температуре } T_2} \quad \text{для поверхностного потенциала } y_{s2},$$

причем  $\Delta y = y_{s2} - y_{s1}$  достаточно мало, чтобы можно было пренебречь изменением параметров ПС в этом интервале. Под терминами «поверхностный потенциал» и «постоянная времени» будем понимать усредненные по границе раздела полупроводника и диэлектрика значения этих параметров.

Производя затем преобразования, подобные проделанным Ядавой [6], можно получить следующее выражение для определения стандартного отклонения поверхностного потенциала:

$$\ln \left( \frac{R_1}{R_2} \right) = \frac{1}{8\sigma} \left[ 1 + \frac{0.7337(\sigma^2 + 1.6370)}{\sigma^2(\sigma^2 + 3)} \right] \Delta y \ln \left( \frac{T_2}{T_1} \right). \quad (10)$$

Подставляя в уравнение (10) величины  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $T_1$ ,  $T_2$ ,  $\Delta y$  известные из экспериментальных данных, решаем (10) относительно  $\sigma$  и находим стандартное отклонение поверхностного потенциала в интервале от  $y_{s1}$  до  $y_{s2}$ . Для нахождения других параметров ПС запишем выражение для  $R_1$ , полученное с помощью формулы (4)

$$R_1 = \frac{(1 - X_{21})^{\sigma/2} \cos \left( \frac{\pi X_{21}}{2} \sqrt{\sigma/2} \right)}{(1 - X_{11})^{\sigma/2} \cos \left( \frac{\pi X_{11}}{2} \sqrt{\sigma/2} \right)} \exp(-a(X_{11}^2 - X_{21}^2)), \quad (11)$$

где  $X_{11} = \frac{\ln(\omega\tau_{11})}{2\sigma^2}$ ,  $X_{21} = \frac{\ln(\omega\tau_{21})}{2\sigma^2} = X_{11} + \frac{\ln(\tau_{21}/\tau_{11})}{2\sigma^2} = X_{11} - \frac{\ln(T_2/T_1)}{4\sigma^2}$ ,  $\tau_{11} = (\sigma_p \bar{V}(T_1)p_0)^{-1} \exp y_{s1}$ ,  $\tau_{21} = (\sigma_p \bar{V}(T_2)p_0)^{-1} \exp y_{s1}$ ,  $\bar{V}(T_1)$  и  $\bar{V}(T_2)$  — средние тепловые скорости основных носителей (дырок) при температурах  $T_1$  и  $T_2$ .

Отметим, что концентрации ионизированных акцепторов  $p_0$  при температурах  $T_1$  и  $T_2$ , входящие в выражения для  $\tau_{11}$  и  $\tau_{21}$ , одинаковы, так как температуры выбираются на участке истощения примеси. Подставляя в уравнение (11) известные величины  $R_1$ ,  $T_1$ ,  $T_2$  и рассчитанное значение  $\sigma$ , решаем (11) численными методами относительно  $X_{11}$ . Затем находим постоянную времени ПС при температуре  $T_1$  и поверхностном потенциале  $y_{s1}$  —  $\tau_{11}$  из выражения

$$\tau_{11} = \frac{\exp(2\sigma^2 X_{11})}{\omega}. \quad (12)$$

Далее определяется поперечное сечение захвата дырок на ПС по известной формуле

$$\tau_p = (\tau_{11} \bar{V}(T_1)p_0)^{-1} \exp y_{s1}. \quad (13)$$

Плотность ПС при поверхностном потенциале  $y_{s1}$  можно легко определить из следующего выражения:

$$\left(\frac{G_p}{\omega}\right)_{T_1, y_{s1}} = \frac{qN_{ss}}{2\sqrt{2}\pi\sigma} \frac{\pi}{(1 - X_{11})^{\sigma/2}} \frac{\exp(-aX_{11}^2 - b)}{\cos\left(\frac{\pi X_{11}}{2} \sqrt{\sigma/2}\right)}, \quad (14)$$

в котором все величины известны после нахождения  $\sigma$  и  $X_{11}$ , за исключением  $N_{ss}$ . Таким образом, решая уравнения (10)–(14), находим все параметры ПС при поверхностном потенциале  $y_{s1}$ .

Подобным образом можно исследовать весь диапазон смещений в области обеднения, где справедливой модель Николлиана-Гоетцбергера и приближение (4). Необходимо отметить, что диапазон наибольшей точности формул (10)–(14) лежит в области  $y_{sm} \pm 4(kT/q)$ , где  $y_{sm}$  — положение максимума одной из кривых нормированной проводимости (максимумы двух кривых лежат близко друг к другу). Это связано с тем, что формула (4) имеет наибольшую точность при  $-0.3 < X < 0.3$  (погрешность в этом диапазоне не превосходит 0.01).

#### 4. Обсуждение результатов

Результаты расчетов параметров ПС по формулам (10)–(14) и по методу Ядавы [6] показывают хорошее соответствие в диапазоне наибольшей точности (рис. 2). Постоянная времени ПС в зависимости от среднего по границе раздела полупроводника и диэлектрика поверхностного потенциала ложится с высокой точностью на прямую линию в полулогарифмических координатах (рис. 3). Небольшие различия в величинах  $\sigma$ ,  $\sigma_p$  и  $N_{ss}$ , получаемых двумя методами, можно объяснить погрешностями машинных расчетов. Две кривые нормированной проводимости, снятые при разных температурах  $T_1$  и  $T_2$ , различаются меньше, чем снятые при двух частотах  $f_1$  и  $f_2$ , так как частоты в

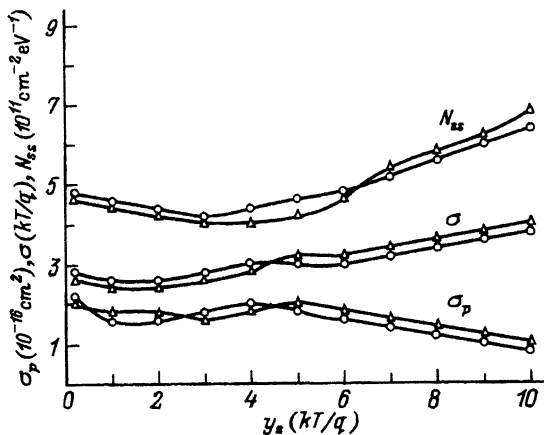


Рис. 2. Зависимость стандартного отклонения  $\sigma$  поверхностного потенциала, поперечного сечения захвата  $\sigma_p$  и плотности  $N_{ss}$  поверхностных состояний от безразмерного изгиба зон на поверхности полупроводника  $y_s$ . Параметры МДП структуры: площадь полевого электрода  $A = 1.18 \cdot 10^{-2} \text{ см}^2$ , концентрация акцепторной примеси  $N_A = 2.68 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$ . Кружки — результаты расчетов по методу Ядавды [6], треугольники — по методу двухтемпературной полной проводимости.

отличие от температур можно варьировать практически без ограничений, в то время как температуры должны лежать в ограниченном диапазоне (150–500 К), чтобы не усложнять компьютерных расчетов. Этот диапазон температур выбран потому, что в нем концентрацию ионизированных акцепторов, поперечное сечение захвата и плотность ПС можно считать не меняющимися с температурой. Подводя итоги, можно сказать, что двухтемпературный метод имеет ряд преимуществ:

- 1) простота аппаратной реализации, возможность использования цифровых измерителей импеданса с высокой точностью, работающих на одной фиксированной частоте;
- 2) простота численных расчетов, для которых можно использовать стандартный метод Ньютона приближенного решения уравнений;
- 3) возможность построения зависимости параметра флуктуаций поверхностного потенциала  $\sigma$  от изгиба зон на поверхности полупроводника.

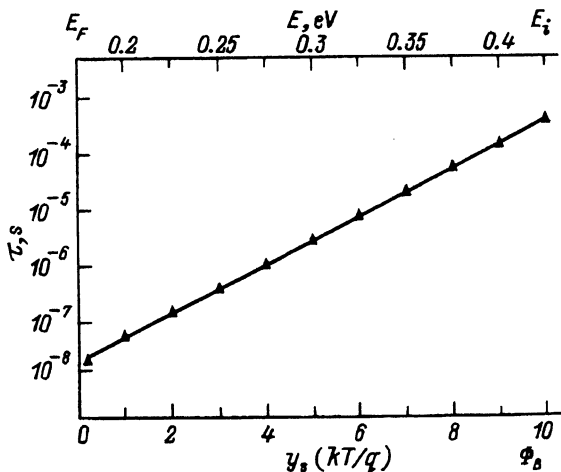


Рис. 3. Время  $\tau$  перезарядки поверхностных состояний, лежащих в области между уровнем Ферми  $E_F$  и серединой запрещенной зоны полупроводника  $E_i$ , по результатам расчетов методом двухтемпературной полной проводимости. На верхней шкале — энергетическое положение поверхностных состояний относительно потолка валентной зоны  $E_v$ .  $\phi_v$  — объемный потенциал полупроводника.

## Список литературы

- [1] E.H. Nicollian, A. Goetzberger. Bell Syst. Techn. J., **46**, 1055 (1967).
- [2] J.G. Simonne. Sol. St. Electron., **16**, 121 (1973).
- [3] J.R. Brews. Sol. St. Electron., **26**, 711 (1983).
- [4] J.M. Noras. Sol. St. Electron., **30**, 433 (1987).
- [5] E.H. Nicollian, A. Goetzberger, A. Lopez. Sol. St. Electron., **12**, 937 (1969).
- [6] R.D.S. Yadawa. Sol. St. Electron., **33**, 127 (1990).
- [7] A. de Dios, E. Castan, L. Bailon, J. Barbolla, M. Lozano, E. Lora-Tamayo. Sol. St. Electron., **33**, 987 (1990).

Редактор В.В. Чалдышев

### **A study of surface states in MIS-structures by the two-temperatures admittance method**

*E.N. Bormontov, S.V. Kotov, S.B. Lukin, S.V. Golovin*

Voronezh State University, 394000 Voronezh, Russia

---